

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 011 709
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 79104112.2

(51) Int. Cl.³: **G 02 B 21/10**

(22) Anmeldetag: 23.10.79

(30) Priorität: 02.12.78 DE 2852203

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.06.80 Patentblatt 80/12

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

(71) Anmelder: International Business Machines
Corporation

Armonk, N.Y. 10504(US)

(72) Erfinder: Wagner, Dietmar
Ludwig-Finck-Strasse 8
D-7032 Sindelfingen-Maichingen(DE)

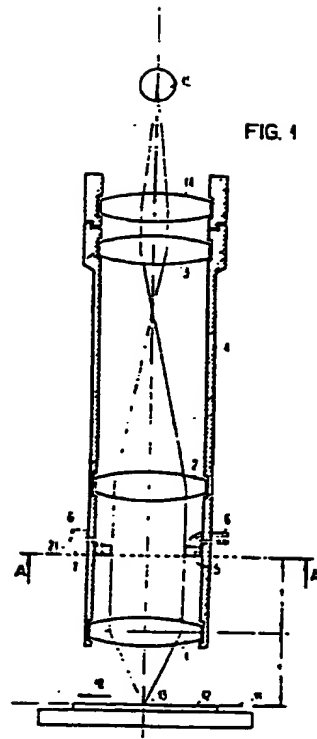
(74) Vertreter: Teufel, Fritz, Dipl.-Phys.
Schönaicher Strasse 220
D-7030 Böblingen(DE)

(64) Vorrichtung zur Aufsichtbeleuchtung.

(57) In der hinteren Brennebene (21) eines (Mikroskop-) Objektivs (1) sind in einem ringförmigen Bereich (5) symmetrisch zur optischen Achse die Endflächen von Lichtleitfasern (6) angeordnet, von denen Lichtbündel ausgehen, die beim Durchgang durch das Objektiv zu Parallelbündeln werden und mit gleichem Einfallswinkel aber verschiedenen Azimutwinkeln auf die Beobachtungsfläche (11) auftreffen. Die so erzeugte ideale Dunkelfeldbeleuchtung bewirkt, daß durch Störungen der Beobachtungsfläche das sonst dunkle Gesichtsfeld im Okular (3) aufgehellt wird. Der Lichtweg kann auch umgekehrt werden, um das von der Beobachtungsfläche ausgehende Licht von den Lichtleitfasern abzunehmen.

EP 0 011 709 A2

./...



Vorrichtung zur Auflichtbeleuchtung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Auflichtbeleuchtung mit symmetrisch um die optische Achse eines abbildenden optischen Elements in einem ringförmigen Bereich angeordneten Lichtleiterendflächen. Sie eignet sich insbesondere als

5 Vorrichtung zur Dunkelfeldbeleuchtung bei Mikroskopen.

Bei der Dunkelfeldbeleuchtung mit Innenlicht nach Köhler wird ein senkrecht zur optischen Achse eines Mikroskops verlaufendes Lichtbündel über ein unter 45° angeordnetes Glasplättchen

10 oder ein Halbwinkelprisma so umgelenkt, daß es parallel zur optischen Achse des Mikroskops über eine durchbohrte Linse oder eine Ringlinse und einen Hohlspiegel auf das Objekt fällt. Derartige Vorrichtungen werden beispielsweise in dem Buch "Optik für Konstrukteure", von H. Naumann, W. Knapp,

15 Düsseldorf 1960, insbesondere 128 ff. beschrieben. Neben den durch die den Beleuchtungslichtstrahl einspiegelnden Elemente bedingten, selbst mit hohem konstruktivem Aufwand nicht ganz vermeidbaren Störungen, wie Erzeugung von Hellfeldbeleuchtungs-Komponenten und Bildfehlern, weisen die oben genannten

20 Beleuchtungsvorrichtungen noch den Nachteil auf, daß für jede Objektiveinstellung eine besondere Justierung des Beleuchtungsstrahlenganges erforderlich ist. Das gleiche gilt für Dunkelfeldbeleuchtung mit Außenlicht.

25 Beide Beleuchtungsvorrichtungen erfordern zudem teure, komplizierte und viel Platz beanspruchende Einrichtungen, die nachträglich, wenn überhaupt, nur schwer in ein vorhandenes Mikroskop eingebaut werden können. In der DE-OS 25 42 075 wird eine Auflicht-Dunkelfeld-Beleuchtungsvorrichtung be-

30 schrieben, bei der der seitlich zugeführte Beleuchtungsstrahl mit Hilfe eines besonderen optischen Elements eine zylinderförmige Intensitätsverteilung erhält und über ein unter

45° zur Mikroskopachse geneigtes und aus einem äußeren ringförmigen, vollverspiegelten und einen inneren teilverspiegelten Bereich bestehendes Ablenkelement über eine Ringlinse und einen Objektivspiegel auf das zu belichtende Objekt gerichtet wird. Durch den vollverspiegelten ringförmigen äußeren Bereich des Umlenkelements wird die Helligkeit im Bereich des zu beleuchtenden Objekts zwar erhöht, die anderen, mit derartigen Elementen verbundenen Fehler, beispielsweise Erzeugung von unerwünschten Hellfeldkomponenten und Abbildungsfehlern, können mit dieser Vorrichtung ebenfalls nicht vermieden werden. Abgesehen von der Kompliziertheit der erforderlichen Apparaturen, weisen beide Vorrichtungen den Nachteil auf, daß die optischen Weglängen der Beleuchtungsstrahlen asymmetrisch um die optische Achse des Mikroskops verteilt sind, was zu einer asymmetrischen Verteilung der Auftreffwinkel der Dunkelfeldbeleuchtung auf die Objektebene führt. Trotz genauester Einstufung des Beleuchtungsstrahlenganges auf die jeweilige Mikroskopeinstellung läßt sich in vielen Fällen ein gewisser, sehr störender Hellfeldanteil und eine Asymmetrie der Beleuchtung nicht vermeiden.

In der DE-AS 22 22 378 wird eine für ophtalmoskopische Zwecke dienende Vorrichtung zur Beleuchtung der Netzhaut mit Hilfe von am Rand einer Beobachtungslinse ringförmig angeordneten Lichtleitern beschrieben, durch die eine möglichst homogene Ausleuchtung der Netzhaut erfolgt, die, wie sich insbesondere aus den Fign. 4 und 6 ergibt, im wesentlichen eine Hellfeldbeleuchtung darstellt.

In der DE-AS 22 11 702 wird eine faseroptische Beleuchtungsvorrichtung beschrieben, in der der Beobachtungsstrahlengang von in einem ringförmig und konzentrisch zu ihm angeordneten, die Beleuchtungsstrahlung übertragenden Licht-

leitfasern umgeben ist. Auch bei dieser Vorrichtung handelt es sich im wesentlichen um eine Hellfeldbeleuchtungsvorrichtung, bei der die Beleuchtungsstrahlung von außerhalb der Objektivlinse auf die Objektebene zur Einwirkung gebracht wird.

Die Erfindung geht von der Aufgabe aus, eine einfache, billige, an praktisch jedem vorhandenen Mikroskop auch nachträglich ohne großen Aufwand anzubringende, im Innern des Mikroskoptubus liegende Vorrichtung zur Dunkelfeldbeleuchtung anzugeben, bei der eine Störung der Abbildungsgüte des Mikroskops und ein Auftreten von Hellfeldkomponenten nicht stattfindet, die ohne besondere konstruktive Maßnahme automatisch mit der Einstellung des Mikroskopobjektivs optimal einjustiert wird und bei der die die Objektebene durchdringenden Beleuchtungsstrahlen eine absolut symmetrische Verteilung der Intensität und der Auftreffwinkel aufweisen. Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Hauptanspruchs beschriebene Erfindung gelöst.

Gegenüber den bekannten Vorrichtungen zur Auflichtbeleuchtung hat die Erfindung den Vorteil, sehr billig, konstruktiv äußerst einfach, extrem raumsparend und unempfindlich gegen Störungen zu sein und selbst bei unterschiedlichsten Anwendungsgebieten keinerlei Justagen erforderlich zu machen.

Da jedes von einem beliebigen Punkt einer in der Brennebene eines optischen Elements liegenden flächenhaften Lichtquelle ausgehende, im allgemeinen divergente Strahlenbündel beim Durchtritt durch das Element in ein streng paralleles Lichtbündel umgewandelt wird, wird durch die erfindungsgemäß ausgebildete ringförmige emittierende Lichtfläche eine Vielzahl von Parallel-Lichtbündeln erzeugt, die unter gleichen Auftreffwinkeln jedoch verschiedenen Azimutwinkeln auf die Objektebene fallen. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß

das gesamte Gesichtsfeld des Mikroskopobjektivs extrem gleichmäßig ausgeleuchtet wird und daß unabhängig von der jeweiligen Einstellung des Mikroskops keinerlei Hellfeldkomponenten auftreten können. Werden extrem hohe Anforderungen an die

5 Einhaltung eines bestimmten Einfallswinkels aller die Dunkelfeldbeleuchtung bewirkenden Strahlen gestellt, so muß der lichtemittierende ringförmige Bereich entsprechend schmal gemacht werden. Ist hingegen ein bestimmter Bereich der

10 Einfallswinkel zulässig oder gar erforderlich, kann die Breite des genannten lichtemittierenden ringförmigen Bereiches entsprechend vergrößert werden, was beispielsweise durch eine Irisblende, durch Auswechseln der die lichtemittierenden ringförmigen Bereiche aufweisenden Vorrichtung oder durch

15 steuerbares Zuschalten weiterer Lichtleitergruppen bewerkstelligt werden kann. Es kann aber auch zweckmäßig sein, einzelne, beispielsweise einander diametral gegenüberliegende Teile des lichtemittierenden ringförmigen Bereiches anzusteuern, so daß eine Dunkelfeldbeleuchtung mit nur aus einer, zwei oder mehr Richtungen einfallender Strahlung erzeugt wird,

20 was beispielsweise bei der Auffindung von sich nur in einer vorgegebenen Richtung erstreckenden Strukturen vorteilhaft sein kann. Derartige Aufgaben treten beispielsweise bei der Ausrichtung von bei der Herstellung von integrierten Schaltungen verwendeten Belichtungsmasken auf, deren Strukturen

25 sich überwiegend oder ausschließlich in zwei zueinander senkrechten Richtungen erstrecken, während die im Ausrichtmikroskop sichtbar zu machenden Ausrichtmarkierungen unter einem Winkel von 45° zur Richtung der zu übertragenden Strukturen angeordnet sind.

30

Da bei der Untersuchung und der Analyse von Kantenformen eine Beleuchtungsvorrichtung erforderlich ist, mit der eine Beleuchtung aus verschiedenen Richtungen und unter verschiedenen Einfallswinkeln erzeugt werden kann, eignet sich die

35 vorliegende Erfindung, mit der sowohl der Azimutwinkel, der

- Einfallswinkel sowie der Winkel des Kegels in dem die Einfallsrichtungen einer gleichzeitig mehrere Einfallswinkel aufweisenden Strahlung liegen, verändert werden können, besonders gut zur Durchführung von Aufgaben der oben genannten Art.
- 5 Durch die gemäß der Erfindung ebenfalls vorgesehene Möglichkeit, den ringförmigen lichtemittierenden Bereich entlang der optischen Achse zu verschieben, ist es weiterhin möglich, kontinuierlich von einer Dunkelfeldbeleuchtung zu einer Hellfeldbeleuchtung und umgekehrt, überzugehen. Die Anwendung der vor-
- 10 liegenden Erfindung ist nicht nur auf Mikroskope beschränkt; sie kann vielmehr im Zusammenhang mit einer Reihe anderer Abtast- und Beobachtungsgeräte mit besonderem Vorteil verwendet werden. So eignet sich die Erfindung besonders gut zur Auffindung und Entdeckung von Kanten, Unebenheiten oder sonstigen
- 15 Störungen der Homogenität einer Fläche, wobei es erforderlichenfalls auch möglich ist, die Beleuchtung über den zentralen Teil der Objektivlinse und die Lichtabnahme über die im Randbereich des Aperaturkegels dieser Linse angeordneten Lichtleiter vorzunehmen. Auch in diesem Fall kann durch
- 20 Verbinden nur einzelner Sektoren mit einem Lichtdetektor eine Vorzugsrichtung für die Beobachtung festgelegt werden.

Die Erfindung wird anschließend anhand der Figuren näher erläutert.

25

Es zeigen:

- Fig. 1 eine Schnittansicht durch ein Mikroskop mit der erfindungsgemäßen Beleuchtungsvorrichtung,
- 30 Fig. 2 eine Schnittansicht durch die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung entlang der Linie A ... A.

Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung besteht aus einem

35 Mikroskoptubus 4, in dem ein Objektiv 1, eine Tubuslinse 2

und ein Okular 3 befestigt sind. Oberhalb des Okulars 3 ist ferner eine Kondensorlinse 14 vorgesehen, durch die von einer im Bereich 15 angeordneten punktförmigen Lichtquelle ausgehende divergente Strahlen parallelgerichtet bzw. das Okular 3 verlassende parallele Strahlen in 15 fokussiert werden. In der Brennebene 21 des Objektivs 1 ist im Tubus 4 eine Vorrichtung 5 angeordnet, die aus einer Vielzahl von in einem ringförmigen Bereich angeordneten Endflächen 7 von vorzugsweise als Glasfasern oder Glasfaserbündeln ausgebildeten Lichtleitern 6 liegen. Die Vorrichtung kann beispielsweise aus einem Kunststoffring mit einer entsprechenden Anzahl von ringförmig angeordneten Löchern bestehen, in denen die einzelnen Lichtleiter 6 befestigt sind. Es ist aber auch möglich, eine entsprechende Anzahl von Lichtleitern 6 in der dargestellten Weise ringförmig anzuordnen und durch ein geeignetes Mittel miteinander zu verkitten. Die in der Vorrichtung 5 zusammengefaßten Lichtleiter 6 sind, beispielsweise wie in Fig. 2 dargestellt, in acht Sektoren 17 sowie in innere und äußere Ringsegmente unterteilt. Wie in Fig. 2 schematisch dargestellt, sind die Lichtleiter jedes inneren und jedes äußeren Ringabschnitts eines Sektors zu Lichtleiterbündeln 8 zusammengefaßt, die über geeignete, zu einer Gruppe 9 zusammengefaßte Lichtschalter mit einer Lichtquelle 10 einzeln oder in beliebigen Kombinationen verbindbar sind. Es ist selbstverständlich auch möglich, jeden einzelnen Sektor und jeden einzelnen Ring jeweils mit einer besonderen, einzeln erregbaren Lichtquelle zu verbinden.

Sind sämtliche Lichtleiter 6 mit der Lichtquelle 10 verbunden, so entsteht in der hinteren Brennebene 21 des Objektivs 1 eine ringförmige Lichtverteilung, die dazu führt, daß aus dem Objektiv 1 eine Vielzahl von praktisch nur aus parallelen Lichtstrahlen bestehenden Strahlenbündeln austritt, die auf die in der vorderen Brennebene 11 des Objektivs liegende Objekzebene 12 unter gleichen Einfallswinkeln, jedoch unter verschiedenen Azimutwinkeln auftreffen. Ein bei Abwesenheit

der Kondensorlinse 14 hinter dem Okular 3 angeordneter Beobachter sieht bei einer störungsfreien Objektfläche praktisch keinerlei Licht, während jede eine Streuung oder eine seitliche Reflexion des Lichtes bewirkende Störung der

5 Objektfläche 12 ein Sichtbarwerden von Licht bewirkt. Ein in Anwesenheit der Kondensorlinse 14, in deren Brennpunkt bei 15, angeordneter Lichtdetektor wird in diesem Fall das Vorliegen von Licht anzeigen. Wird hingegen in der Brennebene der Kondensorlinse 14 bei 15 eine punktförmige Lichtquelle ange-

10 ordnet, so wird das das Objektiv 1 durchsetzende Licht im Punkt 13 auf der Objektfläche 12 zu einem Airy-Scheibchen fokussiert. Bei störungsfreier Objektfläche 12 wird das gesamte, im Punkt 13 reflektierte Licht durch das Objektiv 1 in ein Parallellichtbündel verwandelt, das zur Gänze innerhalb

15 der Ausnehmung der Anordnung 5 verläuft. Tritt jedoch im Bereich des durch das Objektiv erzeugten Airy-Scheibchens eine Störung der Objektfläche 12 auf, so gelangt, wie leicht einzusehen, das gestreute oder das reflektierte Licht auch in den Bereich der Endflächen 7 der Lichtleitfasern 6. Sind

20 diese, was ebenfalls über geeignete, zu einer Gruppe 16 zusammengefaßte, Lichtschalter möglich ist, mit einem oder mehreren Lichtdetektoren verbunden, so kann bei einer Bewegung der Objektfläche 12 in Richtung des eingezeichneten Pfeiles 18 jede Störung der Objektfläche mit großer Genauigkeit loka-

25 lisiert werden, da nur die in den Brennpunkt des Objektivs 1 gelangenden Störungen ein Lichtsignal zu den Lichtleitern 6 gelangen lassen. Zur schnellen punktweisen Abtastung kleinerer Bereiche oder von Teilbereichen ist es selbstverständlich auch möglich, anstelle einer bei 15 angeordneten, stationären

30 punktförmigen Lichtquelle in diesem Bereich ein Abtastraster, beispielsweise nach Art eines Fernsehrasters, zu erzeugen, durch das in der Brennebene des Objektivs 1 ein entsprechend rasterförmig bewegtes Airy-Scheibchen erzeugt wird. Auf diese Weise ist es möglich, auch bei stationärer Objektfläche 12

35 eine Abtastung eines größeren Teilbereichs dieser Fläche zu bewirken. Durch geeignete Verknüpfung der jeweiligen, das

Abtastraster bei 15 erzeugenden Ablenkspannungen mit den Ausgängen der Lichtleiter 6 ist es möglich, genaue Angaben über das Vorliegen und den Ort von Störungen im Bereich der abgetasteten Flächen zu erhalten. Durch selektive Verbindung
5 einzelner Sektoren 17 mit dem nicht dargestellten Lichtdetektor ist es möglich, auch bei dieser Art der Beleuchtung Störungen, beispielsweise Linien oder Kanten mit einer bestimmten Richtung besonders deutlich hervorzuheben.

P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Vorrichtung zur Auflichtbeleuchtung mit symmetrisch um die optische Achse eines abbildenden optischen Elements in einem ringförmigen Bereich angeordneten Lichtleiterendflächen, dadurch gekennzeichnet, daß der die Lichtleiterendflächen (7) enthaltende, zur optischen Achse symmetrisch liegende ringförmige Bereich lichtemittierend ist und in der hinteren Brennebene (21) und innerhalb des Aperaturkegels des abbildenden Elements (1) angeordnet ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine in unmittelbarer Nähe der hinteren Brennebene (21) des abbildenden optischen Elements (1) angeordnete Irisblende zur steuerbaren Veränderung der Breite des die Lichtleiterendflächen (7) enthaltenden ringförmigen Bereichs.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der die Lichtleiterendflächen (7) enthaltende ringförmige Bereich aus mehreren konzentrischen ringförmigen Teilbereichen besteht, wobei zur steuerbaren Änderung der Breite des ringförmigen Bereichs den einzelnen ringförmigen Teilbereichen zugeordneten Lichtleiter-eingangsguppen (8) einzeln oder in beliebigen Kombinationen Licht zugeführt werden kann.
4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der ringförmige Bereich zwecks steuerbarem Übergang von Dunkelfeldbeleuchtung in Hellfeldbeleuchtung in Richtung der optischen Achse verschiebbar angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtleiterendflächen (7) enthaltenden ringförmigen Teilbereiche sektorenweise ansteuerbar sind.
- 5
6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtleiter (6) aus Glasfasern, Plastikfasern oder Faserbündeln bestehen.
- 10
7. Vorrichtung zur Auflichtbeleuchtung mit symmetrisch um die optische Achse eines abbildenden optischen Elements in einem ringförmigen Bereich angeordneten Lichtleiterendflächen nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der die Lichtleiterendflächen (7) enthaltende, zur optischen Achse symmetrisch liegende ringförmige Bereich in der hinteren Brennebene (21) und im Randbereich des Aperaturkegels des abbildenden Elements angeordnet und zur Lichtaufnahme ausgebildet ist.
- 15
- 20
8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ihre Verwendung als Kantenfinder.
- 25
9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ihre Verwendung zur Ausrichtung von Masken bei der Herstellung von integrierten Halbleiterschaltungen.
- 30

FIG. 1

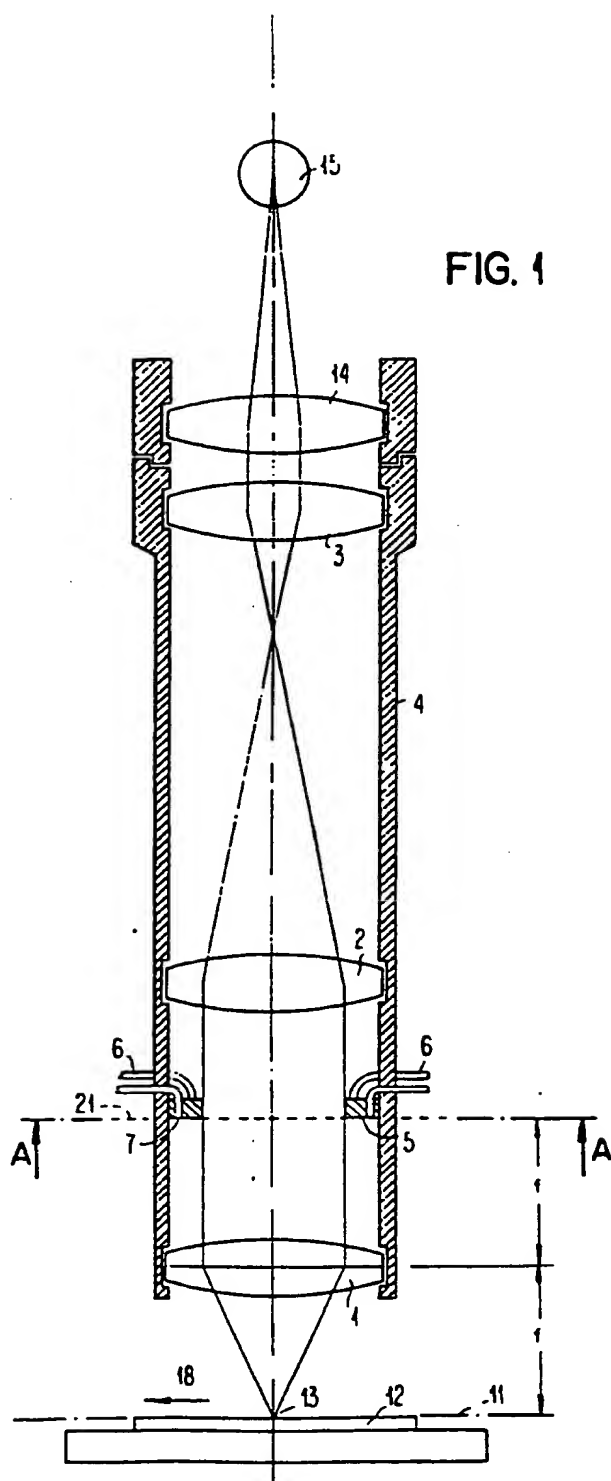


FIG. 2

